

最高分解能×高スループット×自動/省力化 FE-SEM

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 SU9600

Solution for process development

◎ SU9600の特徴 Key features of the SU9600

- 日立独自技術のインレンズSEMが実現する高分解能観察
High-resolution observation enabled by Hitachi's proprietary in-lens SEM technology
- 効率性と高解像度を両立する次世代撮像機能
Next-generation imaging capabilities enable highly efficient observation workflows without sacrificing resolution
- 各種機能による自動化、省力化
A host of new functionality to support automation and streamlined instrument operation



Science for
a better tomorrow



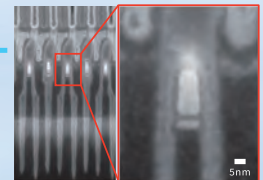
<検出器紹介>

Lineup of Detectors

シンチレータ型
反射電子検出器 (VCD) ※3
VCD: Variable Crystal Detector

Top検出器
(TD) ※3
Upper検出器
(UD)

DRAM断面形状観察事例 (SEモード)



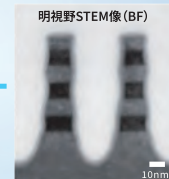
加速電圧: 15 kV
倍率: (左) 200 kX, (右) 800 kX



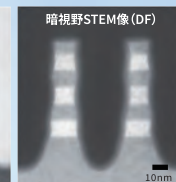
加速電圧: 7 kV
倍率: 1,000 kX

STEM検出器 ※3

GAA構造断面の観察事例



明視野STEM像 (BF)



暗視野STEM像 (DF)

加速電圧: 30 kV
倍率: 800 kX

<スキャン系の強化>

Enhanced scanning capabilities

- 幅広いDwell Time設定
Dwell time configurable over a wide range
- 視野内の関心領域のみ任意箇所の撮像※3
Support for imaging only specific regions of interest at arbitrary locations within the field of view
- 最大 40,960×30,720pixelsの高精細キャプチャー※3
Capture highly detailed images up to 40,960×30,720 pixels
- 自動化支援機能 EM Flow Creator※3との連携が可能
The new scan function can be integrated with the automation software EM Flow Creator

